

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. August 2024 (15.08.2024)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2024/165193 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
B81B 7/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2023/078995

(22) Internationales Anmeldedatum:
18. Oktober 2023 (18.10.2023)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2023 103 045.0
08. Februar 2023 (08.02.2023) DE

(71) Anmelder: **NORTHROP GRUMMAN LITEF GMBH**
[DE/DE]; Lörracher Str. 18, 79115 Freiburg (DE).

(72) Erfinder: **PFEIFFER, Johannes**; Orchideenweg 27a,
79353 Bahlingen am Kaiserstuhl (DE).

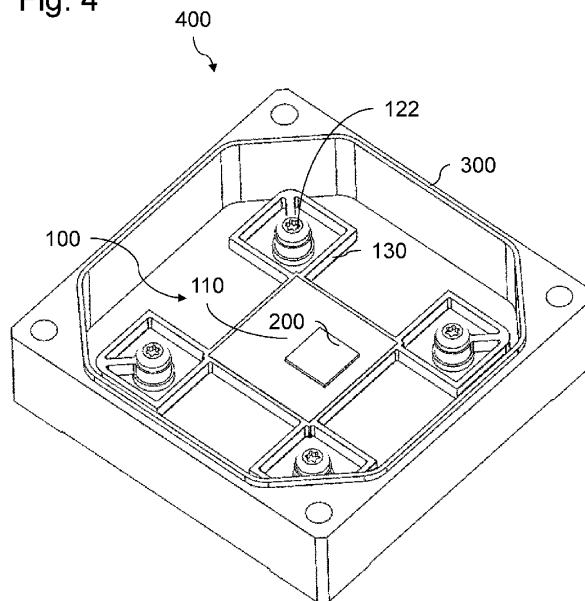
(74) Anwalt: **MÜLLER HOFFMANN & PARTNER PA-
TENTANWÄLTE MBB**; St.-Martin-Strasse 58, 81541
München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ,
DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO,
JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST,

(54) Title: CARRYING APPARATUS FOR CARRYING A MEMS SENSOR

(54) Bezeichnung: TRAGEVORRICHTUNG ZUM TRAGEN EINES MEMS-SENSORS

Fig. 4



(57) Abstract: A carrying apparatus (100) for carrying a microelectromechanical (MEMS) sensor (200) has a carrier platform (110) which is suitable for carrying the MEMS sensor (200), and a coupling structure (120) which has individual, macroscopic springs (130), connected to the carrier platform (110), and which is suitable for being connected to a housing structure (300), wherein the housing structure (300) is suitable for enclosing the carrying apparatus (100) and the MEMS sensor (200) carried by said carrying apparatus.

(57) Zusammenfassung: Eine Tragevorrichtung (100) zum Tragen eines mikro-elektromechanischen (MEMS) Sensors (200) weist eine Trägerplattform (110), die geeignet ist, den MEMS-Sensor (200) zu tragen, und eine Kopplungsstruktur (120) auf, die einzelne, makroskopische und mit der Trägerplattform (110) verbundene Federn (130) aufweist, und die geeignet ist, mit einer Gehäusestruktur

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(300) verbunden zu werden, wobei die Gehäusestruktur (300) geeignet ist, die Tragevorrichtung (100) und den von dieser getragenen MEMS-Sensor (200) zu umgeben.